

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成21年12月17日(2009.12.17)

【公表番号】特表2009-515171(P2009-515171A)

【公表日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【年通号数】公開・登録公報2009-014

【出願番号】特願2008-539092(P2008-539092)

【国際特許分類】

**G 01 R 19/00 (2006.01)**

【F I】

G 01 R 19/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成21年10月29日(2009.10.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路基板上の感知可能な構成要素を組み立てるために用いられるツールに対して、前記回路基板上の感知可能な構成要素が曝露される、ことを監視する装置であって、

回路基板にツールが触れる時、前記回路基板へ加えられる電圧及び電流のうち1つを直接に測定する、測定回路と、

前記ツールが前記回路基板に触れる時、前記回路基板へ加えられる電圧及び電流のうち1つを示す信号を生成する、回路と、を含む装置。

【請求項2】

回路基板上の感知可能な構成要素を組み立てるために用いられるツールによって、前記回路基板上の感知可能な構成要素が曝露される、ことを監視する方法であって、

監視装置を前記回路基板の伝導部分へ直接に接続するステップと、

ツールによって前記回路基板へ加えられる電圧及び電流のうち1つを、前記監視装置を用いて測定するステップと、

前記ツールによって前記回路基板へ加えられる電圧及び電流のうち1つを示す信号を生成するステップと、を含む、方法。